

インライン式スパッタ装置 SP-2500R



長尺の帯状、紐状基材に成膜するための装置です。基材の巻出し室(ロード室)の後及び巻取り室(アンロード室)の前に、各々バッファ室が設けられ、バッファ室の間にエッチング室、冷却室、スパッタリング室が配置されています。有機基材への成膜も出来ます。

インライン式スパッタ装置SP-2500R仕様

○到達圧力	×10 ⁻⁴ Pa台※常温・無負荷・脱ガス時
○排気速度	×10 ⁻⁴ Pa台迄45分以内※常温・無負荷・脱ガス時
○成膜室径	650mmW×350mmD×370mmH
○ロード室径	900mmW×500mmD×350mmH
○アンロード室径	900mmW×500mmD×350mmH
○スパッタ用電源	RF電源 13.56MHz 500W 自動マッチング 1台 逆スパッタ用RF電源 13.56MHz 300W 自動マッチング 1台
○基板形状	帯状 60mm巾×15000mmL
○膜厚分布	±5%以内
○ターゲット寸法	3インチ(金属・絶縁物)
○ターゲット個数	2
○基板回転	ローラ
○基板加熱	無し
○真空排気系(成膜室)	油回転ポンプ:1300L/min 2台 900L/min 1台 クライオポンプ:1000L/sec 2台 500L/sec 1台
○真空排気系(L,UL室)	油回転ポンプ:1300L/min ターボ分子ポンプ:1000L/sec
○操作方法	自動
○ガス系統	マスフローコントローラ 3系統
○ユーティリティ	電気: AC200V三相32KVA 冷却水: 20L/min以上0.1MPa以上0.15MPa以下25℃以下循環 計装エア: 0.5MPa以上 設置寸法: 5000mmW×1500mmD×1800mmH